

工学部教室系技術職員研修(第12回)実施要項

1. 目的

教室系技術職員としての立場と責務を自覚させるとともに、大学における技術職員全般への視野を養い、自己啓発、相互啓発の機会を与えることにより、職員としての資質の向上及び新技術の習得を図る。

2. 対象者

工学部教室系技術職員全員

(超高压電子顕微鏡センター、ラジオアイソトープ総合センター及び大学院情報科学研究科のうち工学部に勤務する者を含む。)

3. 期間

平成15年8月19日(火)～平成15年8月21日(木)

4. 場所

大阪大学附属図書館吹田分館視聴覚ホール

5. 日程

別紙のとおり

6. 研修テーマ

工学部教室系技術職員による技術の継承、発展及び開発について

7. 研修方法

①基調講演及び講演

②学外施設見学(株式会社イオン工学センター及び自由電子レーザー研究施設)

③専門分野等によるグループ又は個人単位によりテーマを設け、研究成果の発表を全体研修の場で行う。

(発表は、口頭発表のほか製作物やパネルを展示し、質疑を行うことも含む。)

8. 講師

①基調講演講師 株式会社イオン工学センター取締役 河島 俊一郎

②講演講師 大学院工学研究科教授 森田 清三

③技官講演講師 工学部技術専門職員 一宮 孝信

工学部技術専門職員 藤谷 渉

9. 研修のまとめ

研修終了後、報告集を発行する。

10. 経費

受講者の研修に要する経費は、工学部の負担とする。

なお、懇親会費は受講者の負担とする。

11. 研修の記録等

研修を修了した者には修了証書を交付し、その旨人事記録に記載する。

12. 研修担当掛

工学部総務課人事掛(内線7207・7208)